



フィールドから学ぶ

石田修一†

Learn in the Field

Shuichi ISHIDA[†]

弊社におけるレーザー加工の生産への適用は、1972年のルビーレーザーによる電力管内のワイヤの切断からスタートした。その後、パルス励起YAGレーザーが実用化され、量産部品であったマグネットロンの組立に適用された。初期における実用化は、従来法では難しい加工をレーザーで行うというものであった。レーザー加工の大きな流れとなるカラー管電子銃の組立への適用は、1978年に実施された。これは、従来法の抵抗溶接を、より管理の容易なパルスレーザー溶接に置き換えるものであった。しかし、本格的置き換えには4年後の光ファイバーによるレーザーパワー伝送技術の実用化を待つ必要があった。光ファイバー伝送技術はレーザー加工のフレキシビリティを高め、生産工程へ導入を一気に加速した。応用も拡大し、これに対応していくために、レーザー発振器の高性能化や光ファイバー関連の光学系の高性能化が進められていった。最終的には、カソード部品の切断からマイクロ溶接、電子銃の組立、ブラン管の組立までの数多くの工程でレーザーが使用され、生産性向上に寄与していった。もう一つの流れは、半導体・液晶管の組立までの数多くの工程でレーザーが使用され、生産性向上に寄与していった。もう一つの流れは、半導体・液晶への適用であった。80年代の初めに半導体パッケージにおいてインクマークにかわる手段としてTEA CO₂レーザーとステンシルマスクを用いたマーカが導入された。導入理由は、保守性の良さと生産性の高さであった。この分野も最終的には、フレキシビリティの高いYAGレーザーと光ファイバー光学系を組み合わせたシステムに置き換わっていった。

†(株)東芝 生産技術センター(〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33)

TOSHIBA CORPORATION 33 Shin-Isogo-cho, Isogo-ku, Yokohama, Kanagawa 235-0017